

Atomizer

基质喷涂仪



精细基质喷涂 | 高效激光转印

- 产品简介

Atomizer基质喷雾仪是全思美特最新研发的基质喷涂装置,该设备主要用于完成MALDI质谱成像检测前的样品表面基质喷涂工作,该设备喷涂舱内可对温度、湿度和惰性气体条件进行调节,可对待测样品表面进行精细喷涂,为后续的MALDI质谱成像检测保驾护航。

另外,该设备可配备激光转印功能,激光转印是一种利用激光转移组织薄膜,增强内源性小分子代谢产物MALDI成像质量的样品前处理方式。具有提升衍生化效果,降低离子抑制效应,增强梯度稀释线性关系等优势。

- 多重设计阻断干扰,全面提升工作效率



氮气置换

运用惰性气体充实舱内环境,减少空气中多种气体对实验结果的影响。

舱内循环

内舱壁设置出风口与回风口,在舱内完成气流循环,使舱内环境均一稳定。

温湿度调节

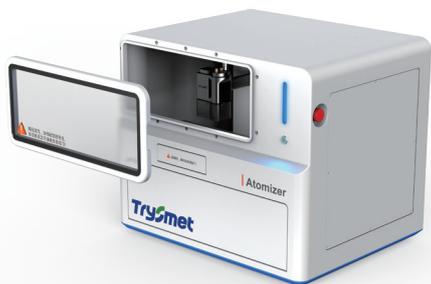
内舱壁设置雾化以及加热模块,可以精准控制舱内温湿度条件。

玻片更换窗

最大程度减少更换玻片时对舱内环境的扰动,减少实验误差,最大化减少稳态回归时间,提升实验稳定性。



- 场景化设计



独立平板操作

与机身分离，操作更灵活。

人性化手位

方便操作人员开盖维护。

开盖也能继续操作

设备调试校准更方便。

- 提升精度，结果更可靠



X向直线电机

放弃传统直线模组，采用直线电机。

双Z轴直线模组单元

解耦激光转印与基质喷涂模块，适应不同光束能量需求场景。

- 软件界面简洁大方



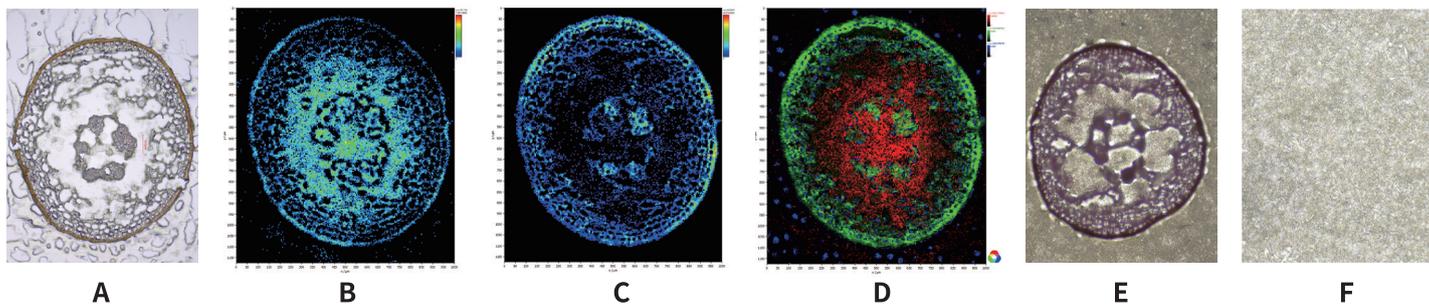
图形化选项

操作方式一目了然，节约学习成本。

双语操作系统

中英文切换自如。

- 效果展示



* A. 红花檫木根切片明场显微图(10x); B. 红花檫木根切片MSI图(空间分辨率5 μ m, m/z=241.1541); C. 红花檫木根切片MSI图(空间分辨率5 μ m, m/z=819.5113); D. 红花檫木根切片MSI叠加图(m/z=951.1779; m/z=918.5827; m/z=228.6788); E. 红花檫木根切片基质喷涂效果图(10x); F. DHB喷涂效果图(40x)。



全思美特(北京)科技有限公司
TrySmet (Beijing) Technology Co., LTD

地址: 北京市经开区嘉创路10号枢密院D3栋
电话: 010-69801864 邮编: 101111

邮箱: info@create-labs.com

官网: http://www.cr-artisan.com



Create质谱成像



Create仪器前沿